

OSK 75GQ M4000 金属分析装置（発光分光分析装置）

優れたアルゴン循環技術を用いる金属分析計です。
Fe、Al、Cu およびその他の基材の分析可能
迅速で正確な定量分析や金属材料の品質管理と科学研究が可能



【特長】

アルゴン循環技術

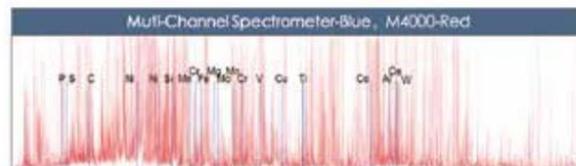
優れた密閉性により、内部のアルゴン純度が長期間維持可能
高度なアルゴンパージ光学系、紫外線素子に最適化された性能
濾過装置により、空気分子が除去され、光学系の信用度が高める
安定した圧力により、光学ドリフトが回避でき、装置の長期安定性が高める
低いアルゴン消費量、経済的



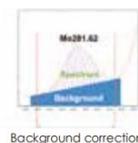
Argon circulation optics

CCD(電荷結合素子)フルスペクトル分析技術

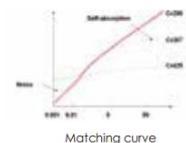
豊富なスペクトル、より良い精度
フルスペクトル識別背景により、分析精度が向上
適切な感度波長を選択し、マルチスペクトル順応技術により、優れたパフォーマンス
多スペクトル適合技術の適用により、スペクトルの干渉を除去でき、正確な測定を実現出来る



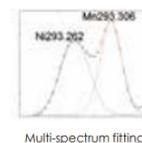
Blue spectrums available for PMT. Red spectrums available for M4000



Background correction



Matching curve



Multi-spectrum fitting

スマートで信頼性の高いデジタルソース

プログラマブルなデジタル火花源、様々なベースに対応、分析精度の向上



発光スタンド

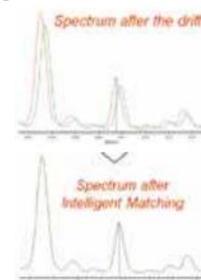
内部空間を小さくした開放型の発光スタンドにより、ガス消費量を削減
4方向アルゴンフラッシング設計により、残留ダストを効果的に除去し、メンテナンスの手間を軽減

高度で安定した光学システム

全波長をカバーするパッシブレンジ光学系、高解像度のマルチCCD検出器を用いる
リアルタイムモニタリングと恒温により、光学システムの安定性を保証

特注試料クランプ

様々なサンプル形状に適應



Drift correction

ワンボタン操作

ワンボタン操作で素早く簡単に扱え、製造現場の要求を容易に対応

独自のリアルタイム・インテリジェント・ドリフト 補正技術

装置の安定性を向上、標準化の頻度を減らす、自動校正、より簡単な操作

インテリジェント・プログラム

より正確な分析結果を得る、未知サンプルの定量分析が可能



品質管理

ユーザーの品質基準に合わせて上限値・下限値を簡単に設定できる
サンプル組成の可否を自動判定

等価分析

編集可能な炭素当量および耐食性当量方程式により、合金の品質管理を向上

自動診断システム

リアルタイムで機器の動作状態を表示するソフトウェアインターフェース

グレード識別

サンプルのグレードを迅速に識別し、未知の材料を簡単に分類

【アプリケーション】

冶金、鋳物工場 金属加工、金属材料の品質識別、新しい合金の応用

【特長】

【製品仕様】	OSK 75GQ M4000
光学システム	パッシェン-ルンゲ光学系 高分解能のマルチCCD検出器 波長範囲 175～520 nm 光学系密閉アルゴン循環システム
発光スタンド	オープン発光スタンド 様々な試料形状に対応する簡単操作の試料クランプ 最適化されたアルゴン循環設計 クリーニングとメンテナンスが容易
励起光源	プログラマブルパルスデジタルソース 最大放電周波数：1000 Hz 最大放電電流：400A スパーク点火パルス：1～14kV スパーク励起パルス：20～230V アーク励起パルス：20～60V
励起穴	直径：13mm
アルゴン要件	要求純度：99.999% 入力圧力：0.5MPa スパーク時最大3.5L/min 平均待機流量 0.1L/分

電気および環境要件	AC220V±20V,50Hz スパーク時最大400VA 平均待機電力：50VA 室温 10°C~30°C 保管温度 0°C~45°C 相対湿度: 20%~80%
EMC	IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5
寸法	長さ×幅×高さ：818mm×590mm×396mm 正味重量：70kg

モデル	波長	説明
OSK 75GQ M4000 N	175-520 nm	Fe、Al、Cu などのベースに使用可能
OSK 75GQ M4000 S	200-520 nm	Al、Cu のベースに使用可能

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2023/10/03